

デジタルファクトリー通信

2026年4月～2026年5月



東京エレクトロン デバイス株式会社

ハイライト

5月 トピックス

| | |
|---|---|
| 1 | 【画像処理マスターへの道】 二光束干渉が切り拓く3次元計測と画像処理を支える最新ライティング技術 —— CCS × TED 技術対談「第2弾」 |
| 2 | 【限定3台 55%OFF!】パーツカウンター モバイル版めばかり君 旧タイプを極限価格で限定販売! |
| 3 | 【製品紹介】設備・データドックサービス |

4月 トピックス

| | |
|---|---|
| 1 | 【画像処理マスターへの道】 ライティングとフォトメトリックステレオ法の最前線 —— CCS × TED 技術対談「第1弾」 |
| 2 | 【ニュースリリース】東京エレクトロンデバイスとアイテス協業 SiCデバイスの潜在欠陥をウェーハレベルで可視化する検査ソリューション |
| 3 | 【AI導入事例】 「目利き」はAIに任せる時代へ ～アスパラの個体差を見抜く、AIの“目”が農業の現場に～ |

【画像処理マスターへの道】

二光束干渉が切り拓く3次元計測と画像処理を支える 5-1
最新ライティング技術
—— CCS × TED 技術対談「第2弾」



※画像をクリックすると直接サイトに移動します

本紙では

本紙では二光束干渉法による高精度3次元計測や最新ライティング技術を紹介しながら照明と画像処理・AIの両面からどのように課題解決するか、対談を通じて具体的に紐解いていきます。「CCSの最新ライティング技術」と「TEDの画像処理技術」で外観検査の現場で直面する課題を解決します。前回好評いただいたCCS × TED 技術対談の第2弾です！

開発中情報も！

目次

1. より高精度な3次元情報の可視化
2. サンプル評価と実機導入のギャップ、照明開発の最前線
3. ハイパースペクトルカメラで「色」と「材料」を見る

▼詳細はこちら

https://www.inrevium.com/pickup/lighting-photometric-stereo-ccs-ted_02/

【限定3台 55%OFF！】パーツカウンター
モバイル版めばかり君 旧タイプを極限価格で限定販売！

5-2

『めばかり君』 キャンペーン

数量管理の手間・ミスを削減。

3台限定 498,000円 (税別)



※画像をクリックすると直接サイトに移動します

パーツカウンターめばかり君は、細かな部品の部品計数作業を、画像処理により補助するシステムです。モバイル版めばかり君を限定3台限りの一斉セールを行います。人手で行っていた計数作業の効率化をリーズナブルに実現できます。

対象製品 : 計数器・パーツカウンター「モバイル版めばかり君」旧モデル
キャンペーン価格 : 498,000円 (税別) (通常価格 900,000円)
数量 : 3台限定
最終発注日 : 2026年8月28日まで

※予定数量に達し次第、終了とさせていただきます

SALE



▼詳細はこちら

https://www.inrevium.com/general/mebakari-kun_campaign/

実際に試して 納得してから導入

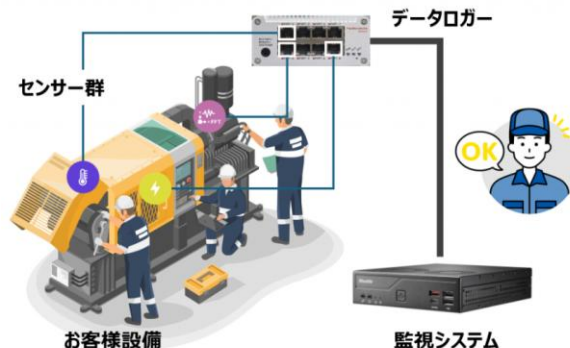
2カ月実機検証

機器設置・設備管理・結果報告まで
すべて含めた導入前検証サービスです。



※画像をクリックすると直接サイトに移動します

効率的・効果的かどうか、試してから導入できると安心。
設備のデータをAIを活用した設備監視システムの構築を検討している企業向けの
サービスです。



▼詳細はこちら

<https://www.inrevium.com/general/equipment-data-dock/>

▼関連製品はこちら

<https://www.inrevium.com/product/cx-d/>

ライティングとフォトメトリックステレオ法の最前線 —— CCS × TED 技術対談「第1弾」



※画像をクリックすると直接サイトに移動します

外観検査の高度化には、対象の材質・形状・サイズ・ライン速度など制約に応じて
照明（見せ方）×画像処理（検出）を両輪で最適化することが鍵です。
CCSの豊富な照明バリエーションとTEDの画像処理の組み合わせにより従来難し
かった検査にも解決策が広がります。

CCS × TED 技術対談 第1弾です！



シーシーエス株式会社

検査用照明、カメラ、レンズをはじめとする機器選定とチューニングノウハウで
「見える!」「出来る!」を実現します。

▼詳細はこちら

<https://www.inrevium.com/pickup/lighting-photometric-stereo-ccs-ted/>

【ニュースリリース】東京エレクトロンデバイスとアイテス協業 SiCデバイスの潜在欠陥をウェーハレベルで可視化する検査ソリューション

4-2

SiCデバイス開発における「見えないリスク」に挑む、新たな取り組みが始まります。

東京エレクトロンデバイスとアイテスが協業し、
潜在欠陥をウェーハレベルで可視化、評価・解析までを一貫して支援。
両社の強みを掛け合わせた検査ソリューションのポイントと、今後の展開をニュースでご紹介します。

【SiC 潜在欠陥検査装置／通電劣化シミュレーター 「ITS-SCX100」】



※本製品は 株式会社アイテス様 との共同開発製品です

▼詳細はこちら

https://www.teldevice.co.jp/pro_info/2026/press_260414.php

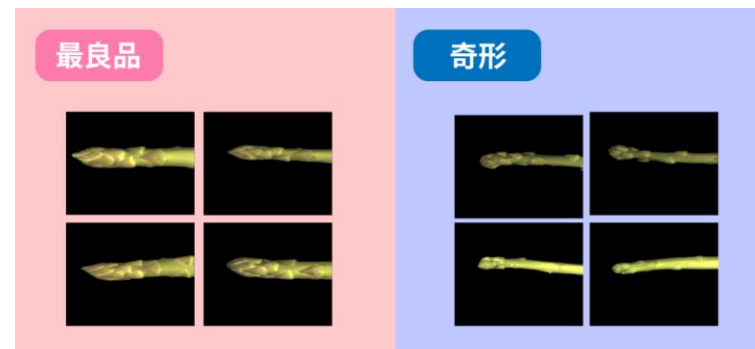
▼関連インタビュー記事

https://www.inrevium.com/pickup/sic-latent-crystal-defect_ites/

【AI導入事例】

4-3

「目利き」はAIに任せる時代へ ～アスパラの個体差を見抜く、AIの“目”が農業の現場に～



※画像をクリックすると直接サイトに移動します

特に穂先が締って、丸みを帯びた最良品と、穂先が育成不良で丸みを帯びた奇形品は、シルエットでは判別が難しいです。
この学習を集中して行ったところ、ほぼ100%の識別が可能となりました。
「これは不良にしたいよね」という感覚に近い判断まで、AIが人間と同じ判断をすることは嬉しい驚きでした。



ナビック株式会社



岡山市にあるナビック株式会社は精密加工技術をベースに
各種電気部品の試作加工、治具・工具の設計製作から産業機器・
農業機器の開発までを手がけています。

▼詳細はこちら

<https://www.inrevium.com/case/navic/>

▼FV-AID / WIL-PDL (AI開発ツール、WIL推論ライブラリ)

<https://www.inrevium.com/product/ai-platform/>

半導体・パネル製造現場 / 工場・ロジスティクス現場

ウェーハの外観検査

高速ウェーハ外観検査装置



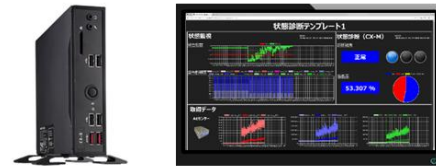
パネル検査装置

外観欠陥検査・点灯検査



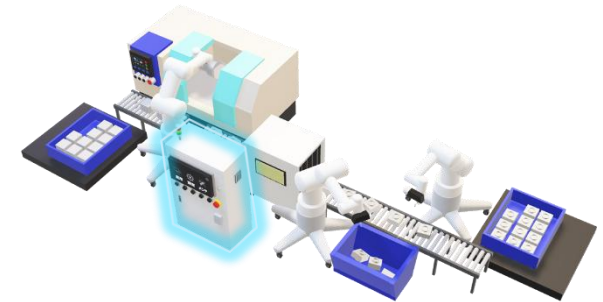
設備・プロセスの監視

設備診断・異常監視システム



人依存の作業自動化

工程作業 連動コントローラー



品質不良の要因調査

時系列データ自動分析マシン



計数作業のDX

パーツカウンター



半導体製造装置 ・ 工作機械 / 加工機 ・ 各種検査装置など

画像処理ソフトウェア

画像処理ライブラリー(Windows/Linux)

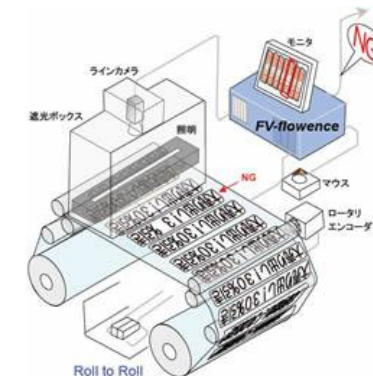
AIプラットフォーム



フィルム検査

検査アプリケーション

FV-flowence



画像処理ハードウェア

画像処理装置 / 画像入力ボード

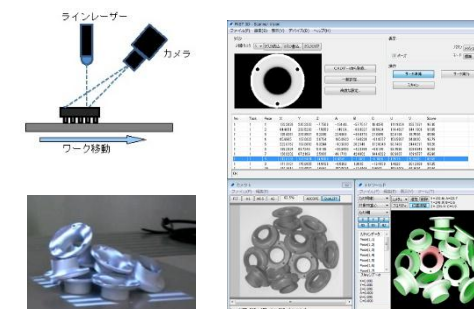
FVシリーズ



3次元計測・検査システム

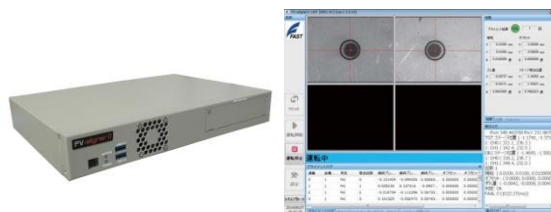
計測検査アプリケーション

FAST-3DPackage



位置決め装置

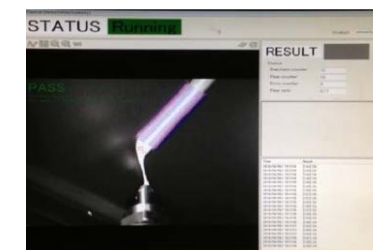
FV-alignerII



塗布検査システム

軌跡補正・検査アプリケーション

FV-Dispense Checker 2D/3D



TED デジタルファクトリーソリューション 詳細一覧

詳しくはWEBで！ <https://www.inrevium.com/>

生産現場

➤ [人依存の工程を自動化](#)

製品

- [自動面取り装置\(ティーチングレス\)](#)
- [工程作業連動コントローラ TriMath \(トリマス\)](#)
- [材料袋のデパレタイズロボット](#)
- [部品の個包装ロボット](#)

ソリューション

- [洗濯機ピッキング・デパレタイズ](#)
- [室外機 ピッキング・仕分け](#)
- [鉱石 ピッキング・仕分け](#)

➤ [予知保全・品質改善](#)

製品

- [異常検知・設備診断システム](#)
- [時系列データ自動分析マシン](#)
- [CSVファイル 可視化・加工ツール \(無料\)](#)
- [簡単IoTエッジデバイス ParaRecolectar](#)

サービス

- [モノづくりDX 計画作成講座](#)
- [設備データドックサービス](#)

ソリューション

- [AEセンサによる設備異常の予兆監視](#)

➤ [計測・検査](#)

フラットパネル検査装置

- [フラットパネル検査装置 FV-pixelence](#)

ウェーハ欠陥検査装置

- [Si ウェーハ 欠陥検査装置](#)
- [SiCウェーハ 欠陥検査装置](#)
- [LT/LNウェーハ欠陥検査装置](#)
- [ガラスウェーハ 欠陥検査装置](#)
- [ウェーハ パターン 欠陥検査装置](#)
- [マスクブランク 欠陥検査装置](#)
- [SiC 潜在欠陥拡張検査装置 \(UV-EVI : UV Expand Visualize Inspection\)](#)

計数・計測機器

- [手挿入基板検査装置](#)
- [計数器・パーツカウンター](#)
- [温湿度モニタリングシステム](#)

装置メーカー

➤ [画像処理ライブラリ](#)

画像処理ライブラリ

- [WIL \(Windows向けライブラリ\)](#)
- [FIE for Linux / FTL for Linux \(Linux向けライブラリ\)](#)
- [FAST Vision Library for LNX \(LNX向けライブラリ\)](#)
- [PyFIE \(Pythonラッパーライブラリ\)](#)
- [FV-AID / WIL-PDL \(AI開発ツール、WIL推論ライブラリ\)](#)
- [FIE for Raspberry Pi \(ARM対応ライブラリ\)](#)
- [FAST Vision ActiveX Components \(Windows向けライブラリ\)](#)

➤ [画像処理装置](#)

画像処理装置

- [FV 1410 \(小型ボックスタイプ\)](#)
- [FV 1420 \(小型ボックスタイプ\)](#)
- [FV 2340 \(モニタワータイプ\)](#)
- [FV 2350 \(モニタワータイプ\)](#)

画像入力ボード

- [CoaXPress画像入力ボード FVC10b](#)
- [Camera Link \(Base\) 画像入力ボード FVC08CLB](#)
- [Camera Link \(Base/Medium/Full\) 画像入力ボード FVC07](#)
- [32点フォトカプラ絶縁I/Oボード FV-II320 / FV-II320-PNP](#)

➤ [計測・検査・位置合わせ](#)

位置決め・アライメント

- [位置決め・アライメント FV-aligner II](#)

印刷検査システム

- [印刷検査システム FV-flowence](#)

三次元計測システム

- [3D計測・検査システム\(ロボットビジョン\) FAST-3DPackage](#)
- [3D計測・検査システム\(光切断\) FV-SurfaceFinder](#)

塗布検査システム

- [塗布検査システム FV-DispenseChecker](#)